# ®日本国特許庁(JP)

# @ 公開特許公報(A) 平1-313804

⑤Int. Cl.⁴	識別配号	庁内整理番号	@公開	平成1年(1989)12月19日
H 01 B 1/2 C 04 B 41/8 C 23 C 18/3	3	A -7364-5G H-7412-4G 6686-4K		
24/0 // B 22 F 7/0	3 ·	A-6813-4K D-7511-4K		
" H 01 C 1/1 H 01 F 15/0	<b>{</b>	Z-7303-5E F-6447-5E		
H 01 G 1/0 4/1	2	7048—5E 7924—5E		
H 05 K 1/0 3/1	) 3	Z −8727−5E B −6736−5E審査請求	未請求	青求項の数 1 (全5頁)

## **公**発明の名称 導電性ペースト

②特 顧 昭63-145018

**20出 題 昭63(1988)6月13日** 

個発	明	者	木	幕	博	道	東京都台東区上野6丁目16番20号	太陽誘電株式会社内
個発	明	者	松	本	和	錢	東京都台東区上野6丁目16番20号	太陽誘電株式会社内
@発	明	者	吉	沢	睦	雄	東京都台東区上野6丁目16番20号	太陽誘電株式会社内
⑦出	顧	人	太陽	易誘	電株式会	社	東京都台東区上野 6 丁目16番20号	
MH.	<b>TE</b>	٨	<b>企</b> 理	1-4-	北佐 和	ф		

### 明如 🕾

# 1. 強明の名称

### 「低性ペースト

### 2. 特許請求の顧照

・ 導電性粒子と無機質粒子とを、 ピヒクル中に 分散させた導電性ペーストに於いて、 前配無機 質粒子が無電解メッキ浴の金属イオンに活性な 表面を有する粒子から成る事を特徴とする導電 性ペースト。

### 3. 発明の詳細な説明

### [産菜上の利用分野]

本知明は、セラミック素地上に導電性ペーストを塗布し、焼成された導体主面上に、メッキ 膜を析出するのに好適な導電性ペーストに関する。

### [従来の技術]

世来、セラミック素地上に導体膜を形成するのに使用される専配性ペーストとしては、 Au、As、Pt、Pd、Cu等の資金属粒子や、Ni、Zn、Al等の単金属粉末等の導電粒子と、

ガラスフリットとを、 ピヒクル中に分散させた ものが知られている。 このような専電性ペース トは、 セラミック蒸板、 セラミックコンデンサ、 圧電体素子、 抵抗体、 インダクタ等の電子部分 に、 スクリーン印刷、 その他の方法等に 依って 途布された後、 焼成され、 導体膜として形成される。 この導体膜は、 前配電子部品の電極或い は、 配線導体として使用されている。

前配導電性ベーストに使用される場電粒子の うち、Au、As、Pt等の場件材料は、高値 であり、価格の変動が大きいことから、これに 代わる場件材料として、単金属者しくは、比較 的安価なCu等の粒子が使用されている。

中金國導電粒子を用いた導電性ペーストで形成された電極は、電極中の導体金風が半田優れ性が悪く、電極の半田付け性が悪い。また、比較的安価な調粒子を用いた導電ペーストは、導体金属それ自体の半田振れ性が良いが、電極の変面が空気中の酸素に依って、酸化され易いため、そのままの状態で空気中に僅かな時間でも

放置すると、導体表面が酸化されて半田付け性が直ぐ悪くなる。このため、これら甲金属や剛等の導電粒子を用いたものでは、導体粒子の表面に予め、酸化を防止するような金属膜、例えば、ニッケルメッキや半田メッキ等を施し、表面の酸化防止と半田付け性の改善を図ることが行われている。

更に、 前記事電性ペーストを基板に数がして 焼成した時の導電性ペーストの収縮率を制御する 目的、 とうミック基板との接着強度を高める 目的、 及び焼成された後の導体の影張係数を、 セラミック基板の影張係数に近似させる目的の ため、 これら導電性ペーストに、 セラミック基 材と同じ材質の粒子や、 セラミック基材の一部 を組成する材料粒子、 或いはこれらとは別種の 無機質粒子を混入することが行われる。

# [発明が解決しようとする課題]

前記従来の導電性ペーストのように、その中に前記無機質粒子を含有させた場合、これを焼成することにより形成された導体膜の衰弱に、

解消することが可能な事電性ペーストを提供する事にある。

# [ 課題を解決するための手段]

すなわち、前記課題を解消する為、本弱明において謝じた手段の契旨は、 導電性粒子と無機質粒子とを、 ビヒクル中に分散させた導電性ペーストに於いて、 前記無機質粒子が無電解メッキ谷の金属イオンに活性な姿面を有する粒子から成る事を特徴とする導電性ペーストである。

### 〔作 用〕

郷電粒子と前記無機質粒子とがランダムに露出 する。

ところが、第2図に模式的に示すように、 このような導体膜10の姿面にメッキ膜を形成されるメッキ膜12の形成速度と、 無機質粒子13の表面に形成されるメッキ膜12の形成速位子13の形に、 大きな差が生じ、 増電粒子11の変面に所望の厚みのメッキ膜12が形成されないといったように、メッキ膜12が形成されないといったように、メッキ膜12の厚みに不均一な状態が生じる。

このように、メッキ膜が不均一となった電子部品は、メッキ膜にいわば無数のピンホールが生じた状態となり、半田に対する密着強度が弱く、半田付け後に電子部品が脱落してしまうといった問題があった。

そこで本発明の目的は、メッキ俗に対して活性な表面を有する無機質粒子を、 導電ペースト中に含有させる事に依って、 前配従来の課題を

近似するため、焼成後のサーマルショックにも 耐えられる。

### [实施例]

次に、本発明の具体的な実施例について詳細 に説明する。

### (奥施例1)

次の組成を育する第一と第二の活性化溶液と、 平均粒径が 1.0μmのアルミナ粒子を用意した。 第一活性化熔液

术

1000m l

坦化第二錫 (SnCli) 28

**均酸(HCl)** 

4 m l

第二活性化溶液

水

1000m l

塩化パラジウム (PdCla) 0.28

塩酸(HCI)

2 m !

まず、前記アルミナ粒子を第一活性化溶液に 浸漬し、室温で5分間投拌し、遮肌と水中分散 とを数回繰り返し、水が透明になった後、予め 50℃の温度に保温された第二活性化溶液に5分 間浸漬し、遮肌と水中分散とを数回繰り返した 後、遮肌された粒子を 120℃の温度で乾燥して、 扱面が無電解メッキ浴の金属イオンに対して活 性化された無機質粒子を得た。

次に、別に用意したニッケル金属粒子(平均粒径3μm) 100重量部に対して、前記アルミナ粒子を10重量部、エチルセルロースを18重量部、ブチルカルビトールを4重量部の割合で配

セラミックコンデンサチップのニッケル膜上に、 室温で降極電流密度 1 k/d m² として 30分間電解 半田メッキを施し、 3 μ m の厚さに半田メッキ 膜を形成した。

この結果、本実施例に於いて、5Kg以下の費量で半田が劉難したものは皆無であった。

(実施例2)

合し、これを拯救物で4時間環域し、更にロールミルに依って1時間退録して、本発明による 選載性のペーストを製作した。

このような積層セラミックコンデンサチップ を前配ニッケルメッキ浴に80℃の温度で15分間 浸渍し、外部電極の表面にニッケルメッキ原を 形成した。

更に市阪の半田メッキ彼を用いて、前記敬履

前記実施例1に於いて、前記第二活性化溶液 に代えて、次の組成を有する第二活性化溶液を 用いた事以外は、同実施例1と同様にして試験 を実施した。

练水

1000m 1

塩化白金 (PtCla) 0.1g

塩酸 (HCI)

4 m 1

その結果、 5 k g以下の荷豆で半田が剝離した ものは替紙であった。

### (英施例3)

即起実施例1に於いて、前起第二活性化溶液 に代えて、次の組成を育する第二活性化溶液を 用いた事以外は、同災施例1と同様にして試験 を実施した。

纯水

1000m l

坦化金 (AuCla) 0.18

塩酸 (HCl)

4 m l

その結果、 5kg以下の荷重で半田が剝離した ものは皆無であった。

( 实施例 4 )

前配実施例1に於いて、ニッケル金属粒子に代えて、銅粒子を用いた事、アルミナ粒子に代えてチタン酸パリウムを用いた事、及び、専びペーストにより形成された殺魔セラミックコンデンサチップの外部電極の表面に、ニッケルメッキに代えて銅メッキを施した形以外は、同実施例1と関様にして試験を実施した。その結集にあった。

### (比較例)

前記実施例1に於いて、 郷電性ペースト中の アルミナ粒子の表面を活性化した粒子に代えて、 導電性ペーストに活性化されてないアルミナ粒 子を加えた取以外は、 実施例1と同様にして試 数を実施した。 その結果、 5 K g 以下の荷重で 半田が倒離したものは、500個中12個あった。

なお、前配各実施例に於いては、無機質粒子 としてアルミナ、 チタン酸バリウムを用いた例 を示したが、 本発明において使用される無機質 粒子は、これらに限るものではない。 すなわち、

とができ、これによって半田付け性が改替され、 蒸板との密着性が良く、半田付けした後に脱落 するような事がなくなる。よって、半田付けの 信頼性が向上すると言う効果が得られる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の導電性ペーストを用いて 形成された導体膜上にメッキを施した状態を示 す模式図、第2図は、従来の導電性ペーストを 用いて形成された導体膜上にメッキを施した状態 感を示す模式図、第3図は、本発明の実施例及 びその比較例における半田付け部分の密登強度 試験の方法を示す説明斜視図である。

10…将体膜 11…線電粒子 12…メッキ 膜 13…無機質粒子

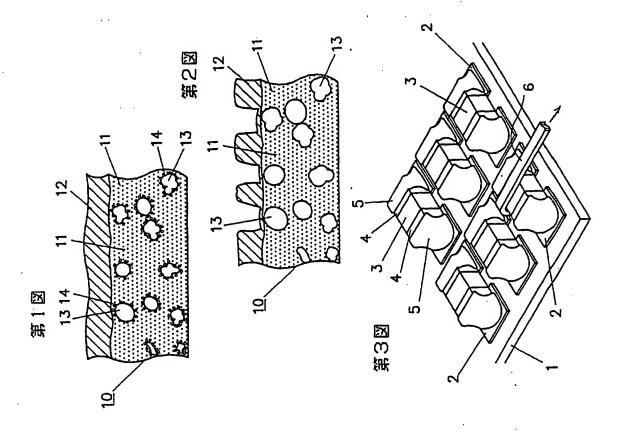
> 特許出项人 太陽誘躍株式会社 代 理 人 弁理士 北條 和由

これら無機質粒子の極頭は、 基板の セラミック 組成に依って選択されるべきもので、 一般的には、 セラミック組成に近似した組成が好ましく、その添加量は各々の組成に於いて、 透宜決められる。 例えば、 熱膨裂係数、 硬化収縮率の大きさや平田付け性等を考慮して決定される。 一般には、 導電性ペースト全型量に対して1%~35%程度の量が添加される。

導電性ペースト中に退合される金属粒子は、 Zn、Cu、Ni、Al等が一般的である。

# [現版の限界]

以上説明した通り、本発明によれば、導電性ベースト中に、無機質粒子を含有させてので、導電性ベーストを塗布し、焼成で割整できるの様成収縮を割整できるの性がう、無機質粒子本来の効果がその質粒子などはないう、無機関粒子本の効果がその質質という、無機関粒子本の対象がその変質となった。そしてこれと同時に、前起無機対しての変面を無電解メッキ浴の金属イオを焼成して得るの表のメッキを絶れた事件の表面に均一な厚みのメッキを絶れた事件の表面に均一な原みのメッキを



THIS PAGE BLANK (USPTO)